

2025 年度 DRP 検討委員会

第 3 回会合議事録

日時： 2025 年 9 月 5 日(金) 10:01～11:56

場所： オンライン

1. 議題：

1. 2025 年度第 2 回会合議事録（案）の確認
2. 2025 年度第 1 回 JP-DRP パネリスト候補者研修会の振り返り
3. シンポジウムの開催について
4. JP-DRP 手続簡素化の論点と UDRP との対比
5. JP-DRP 紛争処理機関の複数化について（継続審議）
6. その他

2. 資料一覧：

- 資料 1 2025 年度 DRP 検討委員会第 2 回会合議事録（案）
- 参考資料 2 2025 年度第 1 回 JP-DRP パネリスト候補者研修会の振り返り
- 参考資料 3 シンポジウムの開催について
- 参考資料 4-1 メールによる ADNDRC 連絡事例
- 参考資料 4-2 JP-DRP 手続簡素化論点リスト
- 参考資料 4-3 JP ドメイン名紛争処理方針のための手続規則(改定案)
- 参考資料 5 JP-DRP 紛争処理機関の複数化について

3. 出席者(50 音順)(敬称略)

	氏名	所属
DRP 検討委員会 委員長	井上 葵	アンダーソン・毛利・友常 法律事務所 外国法 共同事業 弁護士
DRP 検討委員会 委員	卜部 晃史	弁護士法人 瓜生・糸賀法律事務所 弁護士
DRP 検討委員会 委員	早川 吉尚	立教大学 教授/弁護士
DRP 検討委員会 委員	山口 裕司	大野総合法律事務所 弁護士 日本知的財産仲裁センター 運営委員
担当理事	曾根 秀昭	JPNIC 副理事長 DRP 担当
担当理事	中村 素典	JPNIC 理事 DRP 担当

JPNIC 事務局：稲垣 紫、是枝 祐、高山 由香利、根津 智子

4. 傍聴

株式会社日本レジストリサービス（JPRS） 1 名

5. 議事

10 時 01 分に井上委員長により開会された。

議題 1. 2025 年度第 2 回会合議事録（案）の確認

委員からは特段の意見はなく、原案のまま確定した。

議題 2. 2025 年度第 1 回 JP-DRP パネリスト候補者研修会の振り返り

- パネリスト研修会について、前回は上回る当日参加者数に加え、オンライン・オンデマンドでの視聴希望者も増えている旨、事務局より委員へ報告された。
- 研修会後に寄せられた質問への対応を踏まえ、周知性・著名性の要件化をめぐる議論が行われた。議論では、UDRP や国内法との比較を通じて保護範囲を検討するとともに、今後の解説への反映方針について整理した。
- パネリスト研修会についての参加者に関する報告があった。当日参加者数、オンライン・オンデマンドでの視聴希望者も徐々に増加傾向であり、過去 2 年間の参加者を見ても、継続的に参加する層も見えて取れる。

議題 3. シンポジウムの開催について

- 事務局より、2026 年 1 月 23 日開催予定のシンポジウムについて、タイトル案、プログラム構成案、テーマ案を含む原案の説明が行われた。
- プログラム内容や交流会について検討した。現在進めている JP-DRP 概説の改訂や裁定例の分析に関する進捗状況を鑑みつつ、引き続き次回委員会でも検討を継続することとなった。

議題 4. JP-DRP 手続簡素化の論点と UDRP との対比

- 山口委員より、JP-DRP 手続の簡素化に関する検討状況並びに UDRP との比較を踏ま

えた論点整理が示され、背景として、UDRP において申立手続や様式の簡略化がなされていることについて示された。

- 手続利便性の向上にあたっては、紛争処理機関内のオペレーションであるため、機関内でのとりまとめを促す意見に加え、その上で JP における最適解の検討必要性について意見があった。

議題 5. JP-DRP 紛争処理機関の複数化について（継続審議）

- 前回の議論を受けて、ICANN における UDRP 紛争処理機関の認定要件を参考に、ccTLD である JP ドメイン名の紛争処理機関に必要と思われる要件についてまとめる作業について、事務局から検討状況が共有された。
- 議論の結果、要件として日本語や日本法への対応を入れるべきだと考えると、長期的にはともかく短期的には国外の紛争処理機関を対象として検討することは難しいという認識が共有された一方、認定要件そのものについては検討が必要なものであることから、継続して本委員会にて議論していくこととなった。

議題 6. その他

- 次回検討委員会会議は、2025 年 10 月 16 日(木) 9:00～11:00 に開催することとする。

以上をもって、井上委員長により会議は 11 時 56 分に閉会された。

以上